## ⊲XAFS シリーズ(15)⊳

In-situ 偏光全反射蛍光 XAFS (in-situ PTRF-XAFS) 法 田 旺帝\*,朝倉清高 (北海道大学触媒化学研究センター\*)

## 1. はじめに

半導体がないエレトロニックスが想像できないのと同じ く、化学産業において触媒は反応プロセスの勝敗を決める 極めて重要な機能材料である。その代表的な工業用触媒の 一つが不均一系担持金属触媒であるが、それは担体と呼ば れるシリカ、アルミナ、チタニアなどの無機酸化物表面に 活性点となる金属あるいは金属酸化物を高分散させたもの である。その酸化物担体の機能は単に活性点を高分散させ るだけでなく、相互作用により、担体に特徴的な構造、モ ルフォロジー、配向及び電子状態をもつ活性点も形成さ れ、担体により異なった反応が進行すると考えられる。し たがって、より優れた反応性や選択性をもつ新規触媒の開 発にはその活性点構造や物性そして担体との相互作用を知 ることが不可欠である。しかし、不均一触媒の活性点の多 くは高分散状態で長距離秩序構造をもたないため、これま での構造解析手法ではその活性点構造を明らかにすること は困難であった。一方, XAFS 法は長距離秩序構造をも たない系についても構造の情報を得ることができるため、 触媒研究において大きなブレークスルーを与えてきた1)。

さて、その XAFS 振動強度  $\chi(k)$  は K 吸収端の場合、 Eq. 1 に示すように入射 X 線の電場ベクトルと吸収原子と i番目の散乱原子の結合方向とのなす角度 ( $\theta_i$ ) に依存す る特徴を持つ。

$$\chi(k) = \sum_{i} 3\chi_{i}(k) \cos^{2}\theta_{i}, \qquad (1)$$

ここで, $\chi_i(k)$ は,i番目の結合に付随する XAFS 振動で ある。粉末触媒を試料とする通常の XAFS 法ではサンプ ルが等方的であるため、本来 XAFS がもつ角度依存性を フルに活かすことができず,活性点の立体構造や配向を得 ることが難しい。一方,規定された表面構造をもつ単結晶 基板表面を用い触媒の反応メカニズムを表面科学的手法に より考察するモデル触媒の研究が数多く報告されている。 こうした酸化物単結晶基板を担体として用いてその表面に 触媒の活性点構造を固定化したモデル触媒系を用いると, 入射 X 線の偏光方向に対してその基板の方向を変えなが ら XAFS 測定することができ,**Fig.1**に示すように表面 垂直方向及び平行方向の構造情報を分離することが可能と なる。特に入射 X 線の電場ベクトルを基板表面に対して 垂直方向に向けると基板方向の情報が XAFS に強く寄与



Figure 1. Schematic diagram of PTRF-XAFS; (a) s-polarization (E//surface), (b) p-polarization  $(E \perp \text{surface}) *E$ : the electric-field vector of the incident X-ray.

するので,活性点と担体との相互作用に関する明確な知見 を得ることができる。しかし、担体のモデルとして単結晶 基板を用いることで XAFS 測定にいくつか困難が生じ る。まず、担体になる単結晶基板は粉末触媒の担体と比べ 表面積が非常に小さく、単結晶基板上に固定化される活性 点の数は粉末試料に比べ6~7桁も小さいため通常の透過 法による XAFS 測定はできない。一方, こうした低濃度 の表面種を高感度で検出する手法として、 蛍光 XAFS 法 がある。すなわち,X線の吸収により生じる電子・正孔 対は蛍光過程により緩和される。その際、放出される蛍光 X線の収量はX線の吸収量に比例する。さらに、蛍光 XAFS 法は、反応ガス中での測定も可能であるため触媒 研究において有力な手法となる。しかし、Cu, Ni, Co, Mo, Rh など実用触媒に用いられる元素は高エネルギー側に吸 収端を持つため,通常の蛍光 XAFS 法では,単結晶基板 深くX線が侵入することから弾性散乱が発生しやすくな り、S/B(信号対バックグラウンド比)が極端に悪くな る。そこで、X線を基板表面に対して臨界角より小さな 視斜角で入射し、全反射条件を得ることで、基板内部への 浸透が抑えられ、基板から発生する弾性散乱が大幅に低減 する<sup>2)</sup>。したがって、これらを組み合わせた Fig.1 に示 すような in-situ 偏光全反射蛍光 XAFS (in-situ PTRF-XAFS) 法は、これまで特定することのできなかった活性

<sup>\*</sup> 北海道大学触媒化学研究センター 〒060-0811 北海道札幌市北区11条西10丁目 TEL/FAX: 011-706-4959 E-mail: wchun@cat.hokudai.ac.jp

transfer chamber multi-element SSD

measurement chamber

Figure 2. A photograph of the in situ PTRF-XAFS measurement system.

点と担体との相互作用に関する構造情報を与えうる手法で ある。以下の章に最近製作した新型 in-situ PTRF XAFS 装置と研究例を紹介する。

### 2. in situ PTRF-XAFS 測定装置

Fig. 2 に in-situ PTRF-XAFS 測定システムの写真を示 す。この測定システムはサンプル作製用, XAFS 測定 用,そして搬送用の三つの UHV チャンバーで構成されて いる。まず、サンプル作製チャンバーは金属、有機金属錯 体,反応ガスなどの導入機構によりサンプルの作製が可能 であり、作製された試料を LEED, Auger, XPS などの表 面科学的手法で評価することができる。ここで作製したサ ンプルは搬送用チャンバーにより空気中に暴露することな く, 放射光施設の測定ハッチ内にある測定チャンバーまで 移動できる。in-situ 偏光全反射蛍光 XAFS 測定用チャン バーには吸収端が20 keV 以上の高エネルギー側にある元 素に対しても全反射条件を満たすことができる UHV 用の 高精密の6軸ゴニオメーターが装備されている。Fig.3 に示すように、このゴニオメーターは TiO<sub>2</sub>(110)のように 面内異方性表面構造をもつ系においても、入射X線に対し て基板の方向を自由自在に変更できるように工夫されてい る。さらに、測定チャンバーには多素子(Ge 19素子)の Solid State Detector (SSD) を装着して, S/N 比の高い測 定ができるように設計されている。このシステムにより、 実触媒系に近い条件で活性点構造また担体との相互作用に 関する情報を得るだけでなく,表面科学的アプローチによ り単結晶表面が持つ特異な表面構造を活用することで従来 の触媒調製法からは得ることのできない原子・分子レベル で精密に制御された触媒活性点構造調製も期待できる。そ の他、システムの詳しい仕様に関しては文献を参照してい ただきたい<sup>3,4)</sup>。

# 3. 表面構造の配向性や担体との相互作用に関する研究--「ルチル型 TiO<sub>2</sub>(110)上のモリブデン酸化物の構造」

担持モリブデン触媒は部分酸化反応や脱硫反応に活性を



preparation chamber

Figure 3. Schematic diagram of the high-precision UHV-compatible six-axis goniometer and its configuration for measurements against three different polarization directions: (a) s-polarization (E//surface), (b) p-polarization  $(E \perp \text{surface})$  and (c) the second s-polarization (is polarization) but perpendicular to the direction of (a).

示す触媒であり<sup>5,6)</sup>,その構造に関しても Raman, UV-Vis, XAFS などによりその集合状態や担持量依存性,担 体依存性などの情報が得られていた<sup>7-10)</sup>。しかし,活性点 の形成に密接に関係する担体との相互作用については明確 な情報は得られていなかった。そこで,我々は偏光全反射 蛍光 XAFS (PTRF-XAF) 法によりルチル型 TiO<sub>2</sub>(110) 上のモリブデン酸化物の構造を解明し,活性点と担体との 相互作用を明らかにした<sup>11)</sup>。

モリブデンのX線の吸収端は20keVと高エネルギー側 にあり、全反射角度が1.7 mradと非常に浅く、高精度の 全反射角調整が必要である。また、単結晶基板からのブラ ッグ反射も発生しやすくなっている。我々は、超小型の検 出器を用いることで、ブラッグ反射光を避け、蛍光 XAFSを取得した<sup>12)</sup>。担体のモデルとして用いたルチル 型 TiO<sub>2</sub>(110)はこれまでにLEED、XPS、MEED、STM、 ab-initio calculation など様々な手法によりで詳しく研究さ れており、Fig.4に示すように[110]と[001]方向に対し 酸素が並ぶ異方性表面構造をもつことが知られてい る<sup>13-18)</sup>。したがって、3つの異なった偏光方向から XAFS の情報を得ることで基板表面上の3次元活性点構造や担 体との結合情報を明確することができると期待される。そ



Figure 4. Schematic drawing of  $TiO_2$  (110) surface (a) and arrangement for PTRF-XAFS measurements (b) *E*: electric-field vector of the incident X-ray.

こで Fig. 4 のように基板垂直方向(E//[110])と2 種類 の基板平行方向(E//[110]とE//[001])に電場ベクトル の偏光方向をあわせ、3方向で XAFS の測定を行った。 Fig.5に3方向からのPTRF-XAFS 振動を示す。その結 果それぞれの測定方向に対して異なる XAFS スペクトル が観測された。特に[110]方向には k が大きいところまで 周期の短い振動が観測され, Mo-Mo 結合の存在が示唆さ れた。一方,モリブデン酸化物の酸素はモリブデンと様々 な結合距離をもっているため、フーリ変換してカーブフィ ティング法により配位数を求め、モデルを推定する従来の 解析手法の適用は困難である。そこで我々は既存のモリブ デン酸化物の局所構造からモデル構造を作り、多重散乱を 考慮した理論計算を行い、その結果と実験結果とを比較す ることで構造最適化を試みた19)。様々なモデル構造の中 で、モリブデンダイマーモデル構造を仮定することで基板 平行方向に関して実験結果をうまく再現できるようになり, TiO<sub>2</sub>(110)上の[110]方向にMo-Mo結合をもつoctahedral 構造のモリブデンダイマーが形成されていること がわかった。さらに、担体との結合を反映する基板垂直方 向(E//[110])を再現するために担体原子を計算に加え, いくつか可能なモリブデンダイマーの吸着サイトモデルを 仮定し実験結果と比較した。その結果, Fig. 6 のように ちょうどモリブデンダイマー構造を TiO<sub>2</sub>(110)の酸素列を 跨ぐようにして基板表面上に配置させるとFig.5のよう にすべての方向に対して実験結果をうまく再現することが できた。このモデルでは Mo-Mo が0.335 nm で, 基板か らの高さが0.220 nm, 基板中の Ti との距離0.296 nm にな っている。



Figure 5. Mo K-edge PTRF-XAFS oscillations of  $Mo/TiO_2$  (110) (dotted line) and the corresponding FEFF simulations generated from the model structure (solid line): (a) E//[110]; (b) E//[001]; and (c) E//[110].



Figure 6. A proposed model structure of Mo oxides on  ${\rm TiO}_2$  (110).

## 4. まとめ

以上のように単結晶表面のような平坦な基板をサンプル とし,放射光の持つ偏光特性を生かした偏光全反射蛍光 XAFS法は,基板上に高分散した触媒活性点の局所立体 構造情報を与える唯一手法である。これまで,触媒化学で 十分にわからなかった現象,とくに担体一金属相互作用に 新たな知見を与える物と期待される。また,構造のよくわ かった単結晶酸化物表面を用いた新規触媒開発にも広く応 用されるものと考えられる。

### 5. 謝辞

本研究成果は,東京大学大学院理学系研究科岩澤康裕教 授,高エネルギー物理学研究機構物質構造研究所野村昌治 教授との共同研究により得られた物である。また,科学技 術振興事業団戦略的基礎研究の金銭的支援を頂いた。ここ に改め,感謝を表す。

#### 参考文献

- 1) Y. Iwasawa, ed.: "X-ray Absorption Fine Structure for Catalysts and Surfaces", World Scientific, Singapore, (1996).
- S. M. Heald, E. Keller and E. A. Stern: *Phys. Lett.* A 103, 155 (1984).
- 3) W.-J. Chun, Y. Tanizawa, T. Shido, Y. Iwasawa, M. Nomura and K. Asakura: J. Synchrotron Rad. 8, 168 (2001).
- Y. Tanizawa, W.-J. Chun, T. Shido, K. Asakura and Y. Iwasawa: J. Synchrotron Rad. 8, 508 (2001).
- D. Vanhove, S. R.Op, A. Fernandez and M. Blanchard: *J. Catal.* 57, 253 (1979).
- 6) T. Ono, Y. Kubogawa, H. Miyata and Y. Nakagawa: Bull.

Chem. Soc. Jpn. 57, 1205 (1984).

- T. Machej, B. Doumain, B. Yasse and B. Delmon: J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1 84, 3905 (1988).
- 8) J. C. Volta and J. M. Tatibouet: J. Catal. 93, 467 (1985).
- 9) K. Y. S. Ng and E. J. Gulari: J. Catal. 92, 340 (1985).
- H. Shimada, N. Matsubayashi, T. Sato, Y. Yoshimura, A. Nishijima, N. Kosugi and H. Kuroda: J. Catal. 138, 746 (1992).
- W.-J. Chun, K. Asakura and Y. Iwasawa: J. Phys. Chem. B 102, 9006 (1998).
- W.-J. Chun, K. Asakura and Y. Iwasawa: J. Synchrotron Rad. 3, 160 (1996).
- V. E. Henrich and P. A. Cox: "The Surface Science of Metal Oxide", Cambridge University Press: Cambridge, 1994.
- 14) B. L. Maschhoff, J. M. Pan and T. E. Madey: Surf. Sci. 259, 190 (1991).
- 15) H. Onishi and Y. Iwasawa: Surf. Sci. 313, L783 (1994).
- 16) H. Onishi, K. Fukui and Y. Iwasawa: Y. Bull. Chem. Soc. Jpn. 68, 2447 (1995).
- 17) G. Charlton, P. B. Hows, C. L. Nicklin, P. Steadman, J. S. G. Tayor, C. A. Muryn, S. P. Harte, J. Mereer, R. McGrath, D. Norman, T. S. Turner and G. Thornton: *Phys. ReV. Lett.* 78, 495 (1997).
- 18) M. Ramamoorthy, D. Vanderbilt and R. D. King-Smith: *Phys. Rev. B*, **49**, 16721 (1994).
- 19) W-J. Chun: Doctor Thesis, The University of Tokyo (1997).